トノメトリ法による血圧脈波計測原理解析のための 血管断面構造モデルに求められる要件

北脇知己¹⁾, 岡 久雄^{1,2)}

要 約

生体内の血圧脈波を非侵襲的に計測する手法として、「トノメトリ法」が知られており、 近年、この計測手法を用いて得られた血圧脈波波形から、動脈硬化などの循環器系疾患の スクリーニングや予防診断に役立てようという動きが活発である。

しかしながら,組織内の血管を圧迫した場合の血管の変形挙動については,十分な解析 は行われていない。そこで本研究では,生体中のトノメトリ状態を解析可能な数値解析モ デルを構築することを目的とした。

この結果,トノメトリ法による血圧脈波計測の原理解析を行うための血管断面構造の応 力解析モデルには,以下の要件が求められることが明らかとなった。

- ・センサ部と皮膚表面はそれぞれ独立な要素としてモデル化し、これらの接触部において は摩擦を考慮しなければならない。
- ・応力の定量的な解析を行うためには、素材の非線形的な機械的特性を考慮する必要がある。

さらに,実験結果と計算結果を一致させるためには,初期形状を正確にモデル化することが必要であることがわかった。

キーワード:トノメトリ法,有限要素法,数値解析モデル,血圧計測

はじめに

近年,生体内の血圧脈波波形を解析し,血管の硬 さを示す指標を得て,動脈硬化などの循環器系疾患 の予防診断や予後判定に役立てようという動きが活 発である¹¹。このような血管硬さ指標を得るために, 非侵襲的に生体内の血圧脈波波形を計測する手法と して,「トノメトリ法」が知られている²⁻⁴⁾。しかし, これまでに開発されたトノメトリ法を用いた装置は 連続血圧計として用いられているため,血圧脈波波 形ではなく血圧値を用いて装置の検証が行われてい る⁴⁾。このため、トノメトリ法を用いた血圧脈波波 形が,生体内部の血圧波形とどの程度一致するかの 評価は行われていない。

トノメトリ法とは, Fig. 1 に示すように, 円形 な断面を持った血管を上下から平行平板で挟み (Fig. 1 (a)), 血管が押しつぶされて平らな形状と なった部分において (Fig. 1 (b)) 円周方向張力 (T) が血管直上部で無視できることを利用し,非侵襲的 に連続して血管内部の圧力(P)を計測する手法で ある。このようなトノメトリ法の計測原理について は,橈骨動脈部での血圧脈波計測について基本的な 研究がなされているが⁵⁰,この研究では無限長の平 行平板で血管を直接挟む場合を仮定している。しか



Fig. 1 The measurement principle of applanation tonometry.

¹⁾ 岡山大学医学部保健学科検查技術科学専攻

²⁾ 岡山大学医歯工学先端技術研究開発センター

し、実際の生体中での脈波波形計測においては、皮 膚表面においた物体(以下,センサ部)で組織内の 血管を圧迫するため、血管をとりまく組織が血管と センサの間に介在する上、血管に押し下げるセンサ 部の大きさが有限であることなどから、Fig.1に 示すトノメトリ法の基本原理をそのまま適用できる とは考えにくい。そこで、このトノメトリ法を用い た連続血圧計測装置を脈波波形計測装置として臨床 で用いるためには、さまざまな条件下で正しく脈波 の計測が行われているかどうかの検証が不可欠であ る。つまり、「血管や血管周囲組織の構造や材料特 性の変化、あるいはセンサ部の大きさやセンサ要素 の大きさなどの設計要素が、計測される脈波波形に どのように影響するのか。」という、「トノメトリ法 の原理」について検証することが必要となる。

しかしながら,実際の生体中においては,血管変 形挙動や血管内の圧力変化を計測するのは困難であ り,血管や組織の構造や力学特性などの測定も難し いため,これまでに生体においてトノメトリ法の原 理を検証した例はない。こうした状況では,数値解 析モデルを用いた解析は,トノメトリ法の原理を検 討するのに大変有効である。なぜなら,トノメトリ 法の原理検討に必要な構造を自由にモデル化できる, 生体内の材料特性などの検討条件を自由に設定でき る,計算した結果について任意の場所の応力分布を 得られる,などの利点があるからである。

構造力学における数値解析手法の一つに有限要素 法(FEM)がある⁶。この手法は,複雑な構造や非 線形的な要因を解析できる特徴を持つ。このFEM を用いた数値解析を行う際に,現象の本質を的確に 捉えてモデル化するには,ノウハウに相当する熟練 した知識が必要となる⁷。なぜならば,詳細な数値 解析モデルとコンピュータ能力(計算時間)とはト レードオフの関係にあるからである。例えば、素材 の材料非線形性について、もし近似的に線形モデル を用いても解析への影響が小さいのであれば短時間 の計算で済むため線型モデルを用いればよいが、も し非線形性を考慮する必要があるならば、解の収束 のために繰り返し計算が必要となるため、計算時間 は飛躍的に増大することを理解した上で、非線形モ デルを用いる必要がある。このように、トノメトリ 原理解析に用いることができ、なるべく簡単・単純 なモデル構造を持つ数値解析モデルを構築すること が求められている。

そこで本研究では、FEM を用いた、トノメトリ 法の原理解析が可能な血管断面構造モデルを構築す ることを目的とし、各種条件の数値計算結果と、シ リコンチューブを用いたモデル実験結果と比較する ことで、計算が正しく行われていることを確認した 上で、血管内圧力変化(脈圧に相当)を模倣したモ デル実験結果と数値計算結果を比較した。これらの 計算結果とモデル実験結果の比較から、数値解析モ デルに求められる要件について明らかにした。

実験装置および方法

1. モデル実験

1)装置構造

数値解析モデルと比較するために作成した, 橈骨 部動脈を模したモデル実験装置を Fig. 2 に示す。 Fig. 2(b) に示すモデル実験装置の断面構造のよう に, あらかじめ作成したシリコンチューブ(内径 2.01mm, 厚み0.27mm, 長さ150mm)を, このシ リコンチューブよりも柔らかいシリコンゲル(厚み 6.7mm, 幅40mm, 長さ150mm)内に封入した。 シリコンチューブ最上部とシリコンゲルの上面の厚 みは2.1mm である。このシリコンチューブの一端



Fig. 2 Experimental apparatus

Table. 1Experimental conditions

(a) Condition 1

		Measurement											
-	Initial state	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Displacement (mm)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Pressure (kPa)	0.0	3.3	6.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0

(b) Condition 2

		Measurement											
	Initial state	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Displacement (mm)	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5
Pressure (kPa)	0.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0	10.0	20.0

を閉鎖し,逆端をピストンポンプに接続した。ピス トンポンプ,シリコンチューブ内は,すべて水で満 たされている。ピストンポンプの駆動によりシリコ ンチューブ内に任意の圧力を印加でき,印加圧力に 従ってシリコンチューブはシリコンゲル内部で変形 する。シリコンチューブ内部に印加された圧力は, チューブに接続された圧力計で計測できる(Fig. 2 (a):モデル実験装置構成図参照)。

このシリコンゲル表面のシリコンチューブの直上 に、0.2mm間隔で40個の微小なセンサを持つ半導 体ゲージ型圧力センサを表面に設置したセンサ部 (セラミック製:幅6.75mm,長さ13.5mm,角R 0.75mm,高さ10mm)を置き、シリコンゲルから の上向き応力を圧力として計測した。このセンサ部 は、シリコンゲルに押し下げることが可能であり、 その押し下げ量はFig.2(b)に示すようにセンサ部 の上部に設置したマイクロメータで計測した。半導 体ゲージ型圧力センサは、センサ接触前に、あらか じめ大気圧の時に0となるように校正されている。

2) 実験条件

このモデル実験装置を用いた計測ではシリコンチ ューブ内圧とセンサ部の押し下げ変位を,各々独立 に制御できる。そこで,センサ部とシリコンゲルが 接触した状態を初期状態とし,表1のように実験条 件を定めた。まず数値解析モデルの検証を念頭に, 実験条件1として,センサ部押し下げ変位を0.0mm としたまま,シリコンチューブ内に10.0kPaの初期 内圧を印加→シリコンチューブ内圧を10.0kPaに保 ったまま,センサ部を押し下げ→センサ部押し下げ 変位(2.0mm)を保持したまま,さらにシリコン チューブ内圧を20.0kPaまで印加,の手順で計測し た。次に実験条件2として,実際の生体において, トノメトリ法を用いた血圧脈波計測を行う時に用いられている手順を元に,管内圧が脈圧によって変化しているところにセンサ部を徐々に押し下げていく様子を模擬するため,シリコンチューブの初期内圧変化(血管内に最低血圧に相当する圧力を印加)の後,シリコンチューブ内圧変化(血管内の圧力が最高血圧から最低血圧まで変化している様子を模擬)と,押し下げ量変化(センサ部の押し下げを模擬),の手順を繰り返して計測を行った。

シリコンチューブ,シリコンゲルは粘弾性特性を 持っているので,これらの影響をできるだけ排除す るため,手順に従って実験条件を制御した後,十分 な時間の経過後,センサ部にて半導体ゲージ型圧力 センサを用いて圧力を測定した。

2. 数值解析

1)解析ソフトウェア

有限要素法(FEM)解析ソフトウェア「ANSYS/ Multiphysics (Ver7.0 University)⁸⁰」(以下 ANSYS とする)を用いてトノメトリ法の原理解析に用いる 血管断面構造モデルを構築した。ここで、トノメト リ法の原理を解析するためには、血管曲げのような 幾何学的構造非線形、摩擦を含む接触要素を考察す る要素非線形、素材の持つ材料非線形、の三つの非 線形要素が考えらる。ANSYSは、これらの非線形 要素をすべて取り扱うことができる。ANSYS内部 では、解の計算にニュートン・ラプソン法と呼ばれ る反復処理を行って非線形解を求めており、基礎と なる方程式は次の通りである⁸⁰。

$$[K] \{ \Delta u \} = \{ F \} \qquad \cdots \qquad Eq.(1)$$

ただし、[K]:接線剛性マトリクス、 $\{\Delta u\}$:変 位増分ベクトル、 $\{F\}$:加重ベクトル 北脇 知己他



(a) Initial structure

(b) After displacement of sensor Block



2) 数値解析モデルの構造

数値計算結果を実験結果と比較するための数値解 析モデルとして, Fig. 3 (a)に示す左右対称の断面 構造モデルを構築した。センサ部の実際の高さは 10mm であるが,上部構造は数値解析に影響が小さ いとして,解析モデルの高さは5 mm とした。セン サ部を押し込むと, Fig. 3 (b)のようにシリコンゲ ルが押し下げられ,内部のシリコンチューブも変形 する。こうした挙動を解析するために Fig. 4 に示 す拘束条件を定めた。

シリコンチューブ初期形状は, Fig. 5 に示す3 つの初期形状を考えた。それぞれ,シリコンチュー ブが真円形形状を持つ「真円形」,シリコンチュー ブの上下の幅を保ち,横長にした「横長楕円形」, 横平部を持つ「オーバル型」である。これらの初期 形状を用いた理由は,後に述べるようにシリコンチ ューブの初期形状変形が数値計算結果に与える影響 を解析するとともに,実験結果と数値計算結果との 比較検証に用いるためである。



Fig. 4 Calculation conditions of the model

3) 接 触

一般に,センサ部とシリコンゲル表面のように2 つの物体が接触する部位を FEM 解析する場合には, 計算量を少なくするために,接触部分で同じ節点を 共有し,接触部分が動かないようにして計算する場 合が多い⁹。しかし,今回のトノメトリ法の原理解 析のためにはセンサ部をシリコンゲルに押し下げて



Fig. 5 Initial shapes of silicone tubes.

いく過程でのセンサ表面への影響を正確に解析する ため,2つの物体の接触状況を正確にモデル化する 必要があると考えた。

そこでセンサ部とシリコンゲル表面の接触部位に ついて,接触面が自由に滑ることができるように, センサ部とシリコンゲルを別々の節点とし,その間 の領域に接触要素¹⁰⁾を構築した。この接触面では自 由曲面同士の接触問題が発生する。その上で,接触 部位が滑る場合(摩擦なし)と,最大摩擦係数で滑 りが制限される場合(摩擦あり)の2種類について 計算を行った。

4)素材係数

シリコンチューブとシリコンゲルを構成する素材 は高分子材料からなり,超弾性と呼ばれる非線形の 弾性特性を有している。このため,変形が大きくな ると,その変形挙動は線形の弾性率だけでは表現す ることができなくなる。ただし,変形が小さい場合 には,こうした非線形の影響は小さいため,線形の 弾性特性で近似表現することも可能である。そこで, 素材の持つ材料非線形の影響を確認するため,線型 モデルと非線形モデルの両方で計算を行った。

実際の素材の弾性特性は、等方性を仮定し、シリ コンチューブを断片に加工したものと、シリコンゲ ル素材をブロック状に加工したものについて、1軸 の引張・圧縮試験を行い、歪みと応力の関係から求 めた。ここでシリコンチューブには内圧が加わるた め、正の引張歪みに対する値を計測し、シリコンゲ ルには圧縮力が加わるため、負の圧縮歪みを計測し た。この試験結果を基準にして、シリコンチューブ、 シリコンゲルそれぞれの弾性特性として、線形で近 似した弾性率と、5次の Mooney-Rivlin 超弾性材料 モデル¹⁰⁾を用いて表現した超弾性モデルの2つを決 定した。この2つのモデルから得られる応力-歪み 図を Fig. 6 に示す。

5)メッシュ分割

計算精度に影響するメッシュ分割は、ANSYSの 機能の一つである自動分割を用いた。特に、シリコ ンチューブ周辺とシリコンゲル上部の接触発生部で は、大きな変形が起こることが予想されたため、あ らかじめ適当な位置に節点を配置しておき、自動メ ッシュの参考になるようにした。

6) 計算方法

今回の数値解析モデルは、大変形と接触を含む非 線形問題を含むため、静的計算法を用いると、モデ ル実験の計測条件のように一度に大きく条件を変化 させる場合には反復処理が収束しない危険性があっ た。そこで、あらかじめ時間の関数である変位と圧 力を定め、時間ステップごとに反復処理(収束計算) を行って収束解を求める、非線形過渡時間計算法を 用いた。時間ステップは、計算精度を考慮して0.01 秒とした。モデル実験の2つの実験条件に対応して 定めた、押し下げ変位量とシリコンチューブ内圧の 数値計算条件を Fig. 7 に示す。ちなみに、今回の 計算ではシリコンゲルやシリコンチューブの粘弾性 特性は考慮していないため、ここで用いた時間(秒) には絶対値的な意味はなく、数値計算を段階的に進 めるための基準値の意味を持つのみである。

実験結果と計算結果の比較は,数値計算結果から 実験条件に対応する時間ステップを選んで行った。 また実際の計算は,CPU:Xeon3.2GHz (1 MB キャ ッシュ),メモリ:1.5GB (Bufferd ECC),のEWS 上で行った。



Fig. 6 Elastic properties of silicone tube and silicone gel.



Fig. 7 Calculation conditions

1. 数值計算例

まずモデル内での応力分布の数値計算結果例として、シリコンチューブ初期形状を真円形、表面摩擦あり、素材係数は線型モデルとして、数値計算条件1で計算した結果の最終計算結果を示す。Fig.8に応力ベクトル図、Fig.9にX、Y軸方向成分の応力分布図を示した。

果

結

Fig. 8の応力ベクトル図では、矢印の方向が主成 分応力の方向を、矢印の長さが応力の大きさを示し ており、外向き矢印(↔)で表す部分では値が正 の引張応力が、また内向き矢印(→)で表す部分 では値が負の圧縮応力が働いている。Fig. 8(a)は シリコンチューブへの応力集中状態を理解できるよ うにシリコンチューブを含むすべての範囲を、Fig. 8 (b)はそれ以外の部位の応力分布を理解できるよう にシリコンチューブ部を除いた範囲での応力ベクト ルを示した。ここで、図の背景色としてY軸方向応 力分布図を重ねることで、応力値の大きさ分布を容 易に理解できるようにした。この応力ベクトル図か ら、シリコンチューブと部とシリコンチューブ横 部に大きな応力集中が発生していることがわかる。

Fig. 9は、応力の集中したシリコンチューブ部を 除いて応力分布のX, Y軸方向成分を示しており, これらの応力分布から,センサ部の押し下げによっ てシリコンゲルにセンサ部が入り込み、シリコンゲ ル部には主に上下方向の圧縮応力が発生しているこ と、またセンサ部下面ではシリコンチューブの影響 により圧縮応力の分布が発生していること、がわか る。

2. 接触部位摩擦の違い

表面摩擦の違いによる計算結果の違いを検討する ため、数値計算条件1で、真円形のシリコンチュー ブ初期形状とし、表面摩擦のみの条件を変えて計算 を行った。素材係数は線型モデルとしたが、表面摩 擦による計算結果の違いをより明確にするため、弾 性係数を実際の値と変化させた(シリコンチューブ :1.76MPa、シリコンゲル:0.04MPa)。Fig. 10 に、 計算結果のY軸方向応力分布を、表面での摩擦がな い場合(Fig. 10 (a)、(b))と、摩擦がある場合 (Fig. 10 (c)、(d))として示した。このY軸方向

応力成分において,後にセンサ実測値である圧力と 比較するので,圧縮応力値の大きさ(絶対値)につ いて,以下に検討を行う。

表面での摩擦がない場合,センサ部押し下げ変位 を2.0mmとし,初期内圧(10.0kPa)状態(Fig. 10(a))では,センサ部下面のシリコンチューブ直 上の応力(絶対値)はセンサ部表面の周辺部分に対 して比較的小さい値をとる。これは摩擦がないため に,接触面における横方向の剪断応力が緩和される ことで,中心部への応力発生が阻害されるためと考 えられる。一方,摩擦がある場合,同じ状態(Fig. 10(c))では,センサ部の押し下げに伴ってセンサ 部に接触しているシリコンゲルが横方向に移動でき ないためにシリコンゲル表面の応力がそのまま内部 に伝わると考えられ、シリコンチューブ直上の応力 減衰量は,摩擦がない時よりも小さくなる。

このセンサ部押し下げ変位を2.0mm に保ったま まシリコンチューブの内圧を20.0kPa にすると中心 部の応力が高くなるが,表面での摩擦がない場合は, センサ部とシリコンゲル接触面の滑りが発生すると 考えられ,表面での摩擦がある場合の方がその上昇







Fig. 9 Example of calculation result: stress value distribution.



Fig. 10 Calculation result: the effect of surface friction.

量が大きい。

3. シリコンチューブ初期形状と弾性特性の違い シリコンチューブの初期形状を真円形とし、線形 弾性モデルを用い、数値計算条件1で計算した結果 を、実験条件1の実験結果と比較したものを Fig. 11 に示す。図の x 軸はセンサ下面の中心からの距離(mm), y 軸は実験値の場合はセンサ部で計測した圧力(kPa)を,数値計算結果の場合はセンサ部下面での Y 軸方向応力の絶対値(kPa)としている。ここで Y 軸方向応力はセンサ部の下面領域で, 圧縮応力を意味する負の値をとるが,実験値との比







Fig. 12 The effect of initial shapes of the tube and modeling of elasticity.

較を容易にするため、絶対値を計算して表示してい る。

この計算結果では、センサ部押し下げ変位が一定 でシリコンチューブ内圧のみを変化させた時(計測 1~3,計測7~12に相当する)の応力変化は小さ く、実験値の大きな内圧変化と一致しない。

次に、シリコンチューブの初期形状として、横長 楕円形で計算を行った。弾性特性としては線形弾性 モデル (Fig. 12(a)) と、超弾性モデル (Fig. 12 (b)) を用いて計算を行った結果をそれぞれ実験結果と比 較した。図の表現は Fig. 11と同じである。この結 果から,センサ部が2.0mmの一様な押し下げ変位 を保っていて内圧のみが変化した時の応力変化は大 きくなったが,まだ計測値よりも小さい。また,線 形弾性モデルの場合,シリコンチューブ以外のとこ ろの応力が大きくなりすぎており,これはシリコン ゲルの弾性特性として大きな値をとってしまってい ることに由来している。一方,超弾性モデルを用い た場合,端の方(中心から3~4mm ほど離れた付 近)の応力値がよく一致し,実験結果をうまく再現



Fig. 13 The pulse pressure change of condition 2.





できている。

さらに、シリコンチューブの初期形状としてオー バル型を用い、弾性モデル(Fig. 12 (c))と、超弾 性モデル(Fig. 12 (d))で計算を行った結果を実 験結果と比較した。この計算により、中心部の応力 変化が大きくなり、より実験値に近くなった。さら に超弾性モデルの場合、センサの端の部分の応力変 化も実験結果とよく一致した。

4. モデル実験と計算結果との比較

オーバル型のシリコンチューブ初期形状と、超弾 性モデルを用いて,数値計算条件2の場合の計算を 行った。この数値計算結果と実験条件2の実験結果 を比較したものを Fig. 13 に示す。数値計算結果は, 押し下げ量ごとの内圧変化時のシリコンゲル表面で の応力振幅の場所依存性を線で示している。ここで 応力振幅とは,例えば,数値計算結果の場合,押し 下げ量が0.0mmの場合は1.0秒の応力分布と0.5秒 の応力の差を計算したもので、同様に0.5mmの場 合には、2.5秒と2.0秒の応力の差を計算したもので ある。また実験結果も同様に、同じ押し下げ量の時 の2つの内圧の違う計測結果の差から応力振幅を求 めた。この応力振幅はセンサ部の押し下げ量ごとの シリコンチューブ内圧変化(10~20kPa)が、セン サ部でどのように計測されるのかを表している。ま た Fig. 14 には、センサ部の押し下げ量を x 軸とし、 中心からの距離が0mm での応力振幅を示した。こ の Fig. 14 に示すように、押し下げ量に対する中心 部分の応力振幅(最大振幅圧に相当)の変化をみる と、押し下げ量の増加に従って徐々に応力振幅が増 加する傾向が一致している。このように数値計算結 果は、実験結果と全体的な傾向が一致し、実験結果 を良く反映している。

察

老

1. 接触面における摩擦

計算結果から表面摩擦がある場合は、表面での摩 擦力によってセンサ部とシリコンゲルとの間の横方 向のずれ変化が小さくなり、シリコンチューブ直上 のシリコンゲル内の応力が高まることで、シリコン チューブの応力がセンサ部まで到達するため、シリ コンチューブ直上でセンサ部に接触しているシリコ ンゲル表面の応力値が上昇する結果が得られる。ま た、シリコンチューブ直上に相当する中心部の応力 の増加効果も、表面摩擦力を考慮した計算の場合の 方が大きい。 さらに,摩擦がある場合の応力分布図(Fig. 10 (c), (d))において、シリコンチューブの曲がりの強い 部分から斜め上方に向けてシリコンチューブ内の張 力に起因すると考えられる応力増加部が発生してい る。これは、トノメトリ法の計測原理⁴⁰で示された 血管曲げが大きい部分に発生する応力集中と同じ現 象を示している。

これらの検討から,センサ部とシリコンゲル部と の接触面における摩擦を考慮した計算を行う必要が あると考える。

2. 素材の弾性特性

Fig. 12 (d) に示したように,素材の弾性特性と して超弾性モデルを用い,初期形状としてオーバル 型を用いることにより、計算結果は実験結果と良好 に一致した。このときシリコンチューブとセンサ部 に挟まれたシリコンゲルの圧縮状態をみると、押し 下げや圧力が加わった場合に、かなり大きく変形し ている。このような歪みの大きい大変形領域で一定 の弾性率で計算してしまうと、柔らかいシリコンゲ ルの中を応力が伝わらない。しかし、実際のシリコ ンゲルでは、歪みが大きくなると弾性率が大きくな る超弾性傾向を持つため、応力が大きく変化してい ると考えられる。この場合のシリコンチューブ内部 での歪みは、計算結果によると、最大でも±0.1以 下であり、線型モデルと超弾性モデルとの弾性率の 差がそれほど大きくないことから、シリコンゲルの 弾性特性の非線形性の方が、シリコンチューブの非 線形性よりも、応力分布に影響を与えていると考え られる。

以上の,接触面の摩擦と素材の弾性特性の考察から,モデル実験で得られる応力変化を実現するためには,センサ部とシリコンゲルとの間の接触部位で, 節点が自由に滑る構造を持った上で,摩擦力を考慮した数値解析モデルが必要であり,応力変化を定量的に検討するためには,数値解析モデルに素材の非線形を示す弾性モデル,例えば超弾性モデルなどを 用いる必要性があることがわかった。

このとき,シリコンチューブ初期形状の違いによ る計算結果の違いから,実験結果と計算結果を一致 させるためには,血管の初期形状を正確にモデル化 することが必要であることがわかる。

3. トノメトリ法の計測原理解析

実際の生体材料は,特異的な異方性を持ち,特に 橈骨動脈周辺では腱や筋肉が複雑に折り重なってい る上,皮膚表面で発生する張力の影響は,摩擦力と 共に接触状態に影響を与えることが予想される。し かし,トノメトリ法の計測原理を解析する際に最も 重要な点は,血管のつぶれ状態とその内圧変化に対 する変形を検討することである。実験条件2と数値 計算条件2の比較・考察結果から,内圧が変化して いる血管を上下から挟んでその内圧を計測する構造 について,今回構築した数値解析モデルを用いるこ とで,トノメトリ法の計測原理の解析を行うことが できると考えられるため,今回構築した数値解析モ デルはこの役割を十分に果たせるものと考える。

また,今回構築した数値解析モデルは,センサ部 の奥行き(6.75mm)の影響や,生体内部構造の奥 行き方向変化などを無視した2次元断面構造モデル である。しかし,この2次元の数値解析モデルを用 いた場合でも,計算時間は5時間に及ぶため,もし 奥行き方向の情報を取り入れた3次元構造モデルで 計算した場合は,接点数が飛躍的に増加することか ら,実時間での計算が困難になることが予想される。

このため、トノメトリ法の本質である「血管のつ ぶれ状態とその内圧変化に対する変形」を検討可能 で、かつ、なるべく簡単な構造を持つ数値解析モデ ルは、今回構築した数値解析モデルであり、この数 値解析モデルを用いることでトノメトリ法を用いた 生体血圧脈波計測の原理解析が可能だと考える。

本研究によって、トノメトリ原理の解析が可能な 数値解析モデルが確立できたので、今後はこの数値 解析モデルを用いて、さまざまな構造や素材条件の 違いによる、生体内でのトノメトリ原理・現象を解 析することで、脈波が正しく計測できていることの 確認を行っていきたい。

結 論

本研究によって,トノメトリ法による血圧脈波計 測の計測原理を解析するための血管断面構造の数値 解析モデルには,以下の要件が求められることが明 らかとなった。

・センサ部とシリコンゲル表面はそれぞれ独立な要

素によって構成され、この要素間の接触部では摩 擦を考慮しなければならない。

・応力の定量的な解析を行うためには,素材の非線 形的な機械的特性を考慮する必要がある。

さらに,実験結果と計算結果を一致させるために は,初期形状を正確にモデル化することが必要であ ることがわかった。

謝 辞

本研究は、岡山大学がオムロンヘルスケア株式会 社より受託した「動脈圧脈波計測原理研究」の研究 結果の一部である。研究の委託をいただき、また実 験データのご提供など、さまざまな面でご協力いた だいたオムロンヘルスケア株式会社に感謝する。

文 献

- Oliver, J. J., and Webb, D. J.: Noninvasive Assessment of Arterial Stiffness and Risk of Atherosclerotic Events in Arterioscler Thromb. Vasc. Biol., 23: 554-566, 2003.
- 2) Matthys, K., and Verdonck, P.: Development and modeling of arterial applanation tonometry: A review in Tech. Helth. Care 10:65-76, 2002.
- 3) Saba, P. S., Cavallini, C., Scorzoni, D., Longhini, C., Pini. R., Ganau, A.: Arterial tonometry: principles and clinical application in hypertension in High Blood Press., 5:241-250, 1996.
- 4) Kemmotsu, O., Ueda, M., Otsuka, H., Yamamura, T., Okamura, A., Ishikawa, T., Winter, D. C., and Eckerle, J. S.: Blood pressure measurement by arterial tonometry in controlled hypotension in Anesth. Analg., 73(1):54-8, 1991.
- 5) Drzewiecki, G. M., and Noordergraaf, A.: Arterial tonometry: review and analysis in J. Biomech., 16(2): 141-152, 1983.
- 6) 矢川元基, 吉村 忍: 有限要素法. 培風館: 東京, 1991.
- 7)東町高雄:有限要素法のノウハウ.森北出版株式会社: 東京,1993.
 8) ANSVE 70. Theorem Beforence Manual ANSVE Inc.
- ANSYS 7.0 Theory Reference Manual. ANSYS Inc.: Canonsburg PA, 2003.
- 9) CAD/CAE 研究会編: ANSYS 工学解析入門. 理工学 社:東京, 2001.
- ANSYS 7.0 Element Reference Manual. ANSYS Inc.: Canonsburg PA, 2003.

Requiring factors in structural model of the blood vessel for the principle analysis of measurement of blood pressure waveform by applanation tonometry.

Tomoki KITAWAKI¹⁾ and Hisao OKA^{1,2)}

Abstract

"Applanation tonometry" is well known method as the technique which measures blood pressure waveform in vivo non-invasively. Recently, utilizing for screening and prevention diagnosis of circulatory system diseases such as the arteriosclerosis from the blood pressure waveform gotten by this measurement technique is very actively being investigated.

However, the sufficient analysis is not carried out on the deformation behavior of the blood vessel in real human body. Consequently, the purpose of this paper is to construct the analyzable numerical model in respect of the applanation tonometry.

As this result, following factors are necessary in the numerical analysis model of cross sectional structure of blood vessel for the principle analysis of the blood pressure waveform measurement for applanation tonometry.

1) Sensor block and skin surface must have the independent structure, and it must consider the friction in the contact area. 2) For the quantitative analysis, it is necessary to consider the hyper-elasticity which is a nonlinear material property. In addition, it is necessary to accurately model the initial shapes of the material.

Key Words : Applanation tonometry, Finite Element Model, Numerical calculation, Blood pressure measurement

Department of Medical Technology, Faculty of Health Sciences, Okayama University Medical School
Research Center of Biomedical Engineering, Okayama University